

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年6月2日(02.06.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/113514 A1

(51) 国際特許分類:
F16K 27/02 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/035950

(22) 国際出願日: 2021年9月29日(29.09.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

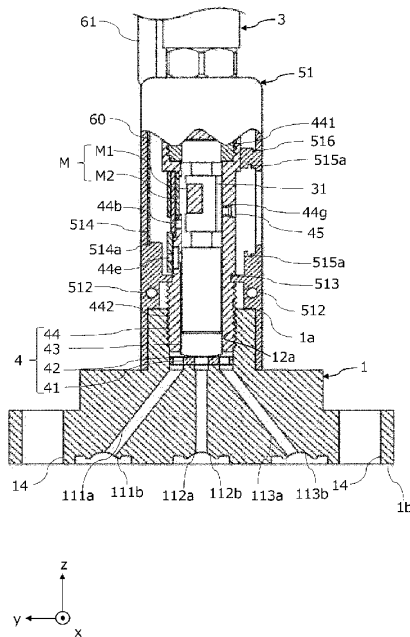
(30) 優先権データ:
特願 2020-197935 2020年11月30日(30.11.2020) JP

(71) 出願人: 株式会社フジキン (FUJIKIN INCORPORATED) [JP/JP]; 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 Osaka (JP).

(72) 発明者: 辻野 健吾(TSUJINO Kengo); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 丹野 竜太郎(TANNO Ryutaro); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 芝田 裕登(SHIBATA Hiroto); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 原田 章弘(HARADA Akihiro); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 中田 知宏(NAKATA Tomohiro); 〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号 株式会社フジキン内 Osaka (JP). 篠原 努(SHINOHARA Tsutomu);

(54) Title: FLUID CONTROL DEVICE

(54) 発明の名称: 流体制御機器



(57) Abstract: [Problem] To provide a fluid control device which is compact and with which data pertaining to the internal operation of the device can be acquired. [Solution] A fluid control device V which is disposed in a flow path of a fluid and with which data pertaining to internal operation can be obtained, said fluid control device V comprising: a sensor bonnet 44 to which is installed one or more sensors M2 for detecting operation inside the fluid control device; a valve body 1 which is connected to the sensor bonnet; a diaphragm 42 which is held inside the valve body and below the sensor bonnet; a cover part 5 which covers the outer periphery of the sensor bonnet; and a circuit board 60 which is electrically connected to the one or more sensors and which is provided inside the cover part such that the thickness direction of the circuit board is identical to the flow path direction.

(57) 要約: 【課題】小型で、かつ、機器の内部動作に関するデータを取得可能な流体制御機器を提供する。【解決手段】流体の流路中に配置され、内部動作に関するデータを取得可能な流体制御機器Vであって、流体制御機器内の動作を検出するための一又は複数のセンサM2が取り付けられたセンサボンネット44と、センサボンネットと連結されるバルブボディ1と、バルブボディの内部において、センサボンネットの下方に保持されるダイヤフラム42と、センサボンネットの外周を覆うカバー部5と、センサに電氣的に接続されると共に、カバー部の内側において、回路基板の厚さ方向と流路方向とが同方向に配設される回路基板60と、を備える。

[続葉有]

WO 2022/113514 A1

〒5500012 大阪府大阪市西区立売堀 2 丁目 3 番
2 号 株式会社フジキン内 Osaka (JP).

(74) 代理人: 粕 川 敏 夫 (KASUKAWA Toshio);
〒1020083 東京都千代田区麹町 3 - 5 - 2 B
U R E X 麹町 4 0 4 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))